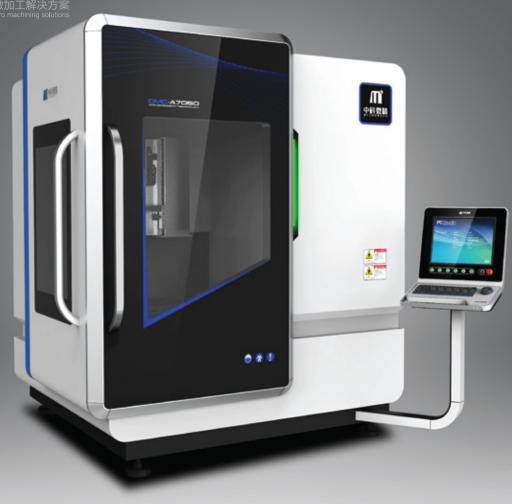


中科微精 | 激光微加工解决方案



紫外四轴刻蚀设备

UV 4-axis laser etching machine

产品型号 GMC-A7060

设备采用紫外纳秒脉冲激光器作为加工光源,可实现大尺寸 回转体表面、三维微曲面及二维平面的表面精密刻蚀。该设 备在三维表面高效高精度刻蚀方面极具优势。

- 龙门式+转台机床结构,满足大尺寸回转体零件表面刻 蚀,兼容三维微曲面及平面刻蚀需求;
- 具备机械轴+振镜三维五轴联动功能, 保证刻蚀连续无 拼接, 高精度、高效率;
- 具备模型重构功能,通过测量模块与控制软件结合,实 现三维零件模型仿真重构, 无模型全工件仿真功能, 适 用于多种加工零件;
- 具备三维模型曲面插补及路径优化功能,能快速针对加 工模型进行加工预处理;
- 具备防碰撞报警功能,保证加工过程中的安全性;
- 具备专用刻蚀软件,三维回转模型图像定位及平面图像 测量,硬件/流程状态监控及权限配置功能。

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
机床行程(X/Y/Z轴) (mm)	800 / 700 / 500
(B轴) (°)	n×360
定位精度(X/Y/Z轴) (mm)	0.005 / 0.005 / 0.01
(B轴) (arc sec)	30
重复定位精度(X/Y/Z轴) (mm)	0.003 / 0.003 / 0.005
(B轴) (arc sec)	15
快移速度(X/Y/Z轴) (mm/s)	300 / 300 / 100
转速 (B轴) (rpm)	10
零件最大重量 (kg)	20
激光器平均功率 (w)	15
激光器脉冲宽度 (ns)	< 100
激光器输出波长 (nm)	355
工作台最大荷重 (kg)	30
设备重量 (kg)	5000

设备占地尺寸 (mm) 2000(宽)×2000(深)×2200(高)



